



SEMI®  
International  
Standards

## SEMI Standard Publication Certificate

### SEMI 标准发布证书

NO.:2015-09

Standard No.: SEMI PV67-0815  
标准编号: SEMI PV67-0815

Standard Name: Test Method for the Etch Rate of a Crystalline Silicon Wafer by Determining the Weight Loss

标准名称: 晶体硅片腐蚀速率测试方法: 称重法

Publication Date: August, 2015  
发布日期: 2015年8月



# 标准编制工作组

SEMI PV67-0815

**主编单位：** 英利集团有限公司

**参编单位：** 常州天合光能有限公司、无锡尚德太阳能电力有限公司、苏州阿特斯阳光电力科技有限公司、中国电子科技集团公司第四十八研究所、国家太阳能光伏产品质量监督检验中心、国家光伏产业计量测试中心福建省计量科学研究院、江苏省微电子化学工程技术研究中心、昆山希铂电子科技有限公司、常州市天之平仪器设备有限公司、福州华志科学仪器有限公司、光为绿色新能源有限公司

**起草人：** 孙凤霞、宋登元、王涛、张红妹、李英叶、王子港、唐三春、梁哲、陈如龙、许涛、姜小松、刘文峰、周洪彪、刘良玉、吴媛、罗海燕、戈士勇、何珂、Ton Schless、刘尔明、徐晟磊、王文卿、武振宇